Моделирование и проектирование микросистемы сенсоров деформаций

Цель и задачи работы

Цель работы – поведенческая модель микросистемы сенсоров деформаций при повышенной температуре

Задачи работы

- 1. Анализ и выбор принципа действия
- 2. Построение модели
- 3. Оптимизация конструкции

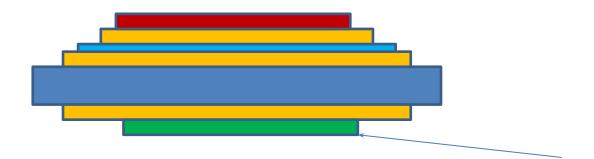
Исходные данные к моделированию и проектированию

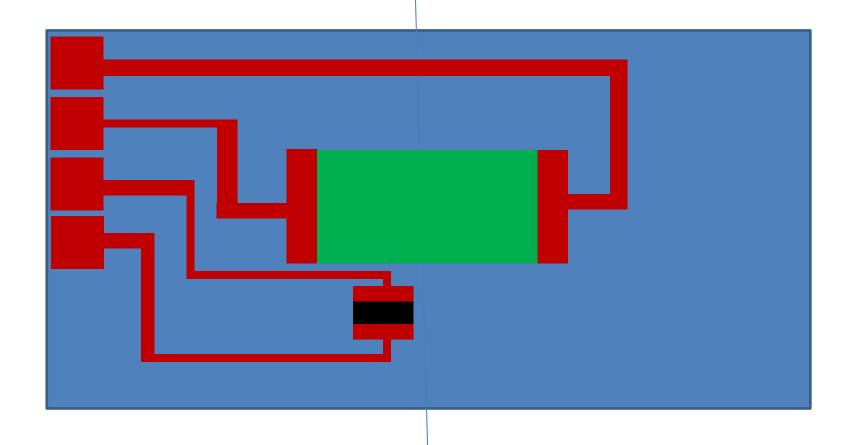
•	Температура деформации100 оС
•	Геометрические размеры исполнительного компонента150х20х6 мм
•	Угол поворота исполнительного компонента0-180 угловых градусов
•	Радиус кривизны исполнительного компонента при деформации12 мм
•	Температура эксплуатации сенсоров 0-100 С
•	Принцип преобразования «деформация-электрический сигнал»тензометрия
•	Принцип преобразования «температура-электрический сигнал»терморезистивный
•	Количество циклов деформаций1 млн
•	Наличие блока преобразования да
•	Тип нагревателяпленочный

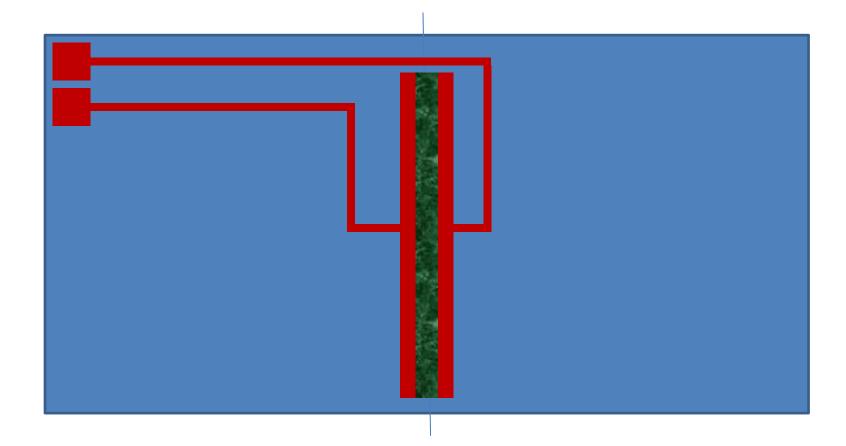
Анализ и выбор принципа действия

Исходное положение

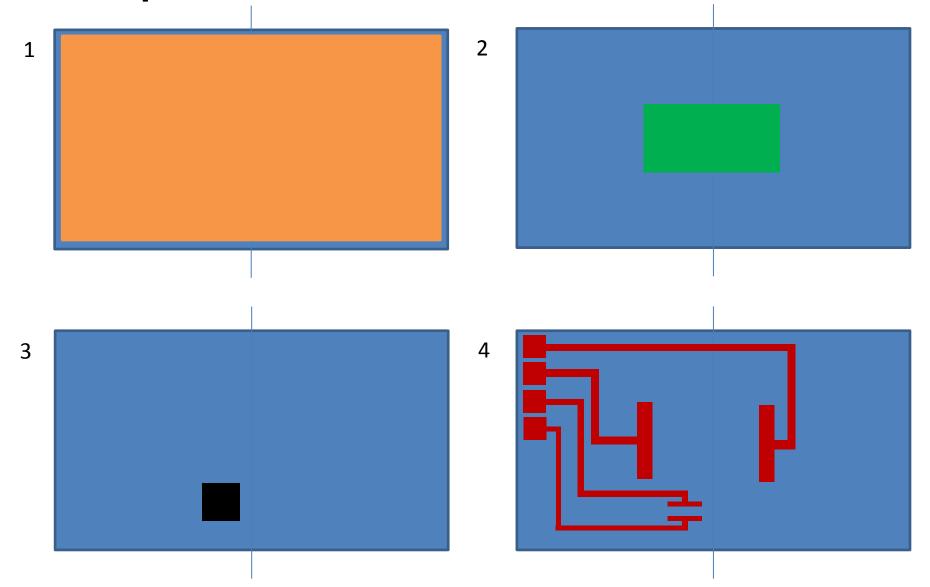
Деформированное положение



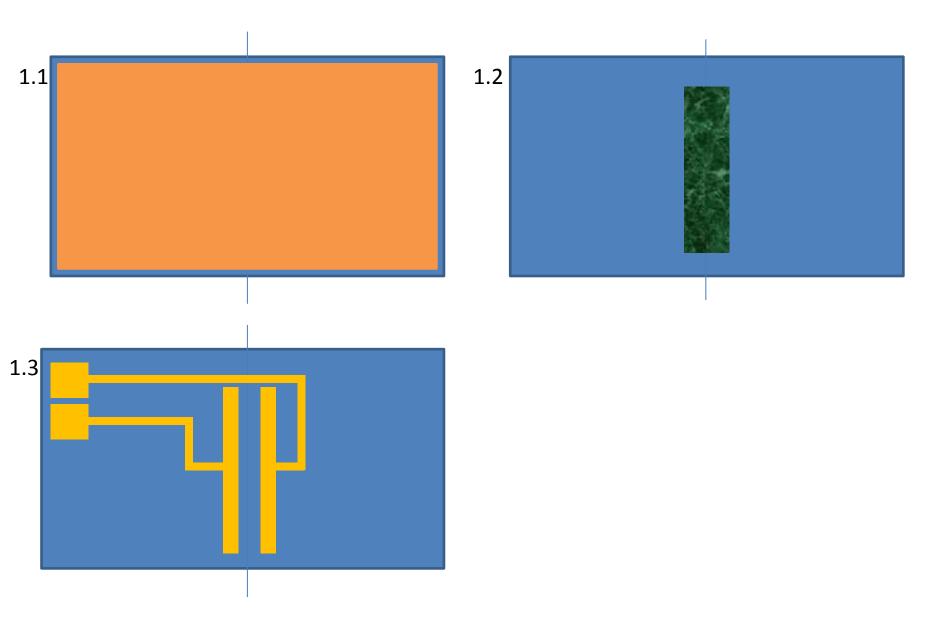




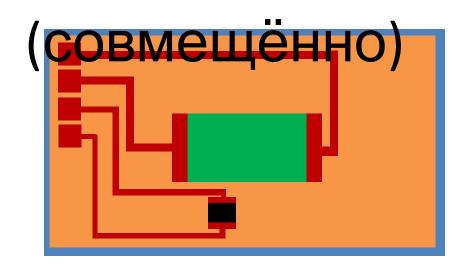
Верхняя послойная топология

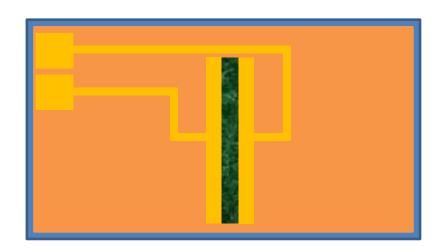


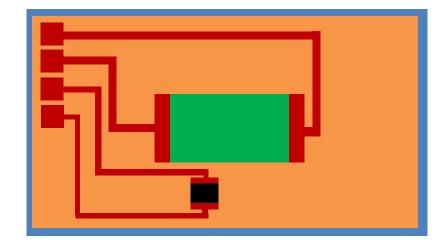
Нижняя послойная топология

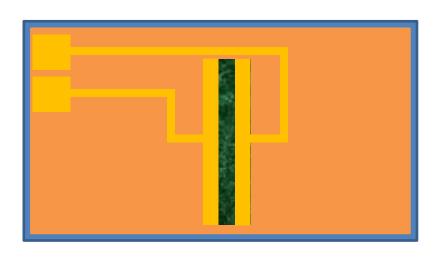


Послойная топология









Наименование слоёв

- 1. Исполнительный компонент (Ti-Ni)
- 2. Диэлектрик (ПСФ)
- 3. Тензорезистор (Ni-Cr)
- 4. Терморезистор

Тензометрический 0CПьезоэлектричеки й

Температура деформации 100 оС
Геометрические размеры исполнительного компонента .150х20х6 мм
Угол поворота исполнительного компонента 0-180 угловых градусов Радиус кривизны исполнительного компонента при деформации 12 мм
Температура эксплуатации сенсоров 0-100 С

Размеры макс габаритные 20x10 MM Материал тензорезисторо В фольговые металлические от 0,2 мм - полимерный композиционн ый пленочный Толщина слоев со стороны нагревателя не более 0,3 мм С0 стороны сенсора не более 0,75 мм

Вопросы к понедельнику

• Свойства всех материалов которые используются в конструкции

Сплав никель-хром удельное сопротивление нихрома 1. 1·10⁻⁶ Ом·м Температурный коэффициент сопротивления 0,0001 K⁻¹

коэффициент тензочувствительности $0.1 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$ пленочный

 Механизм влияния температуры на сопротивление тензорезисторов

Снижение чувствительности 0,01-0,02 %/град

- Материал и геом размеры тензорезисторов
- Изменение сопротивл тензорезисторов при деформациях заданных размеров

Литература

- Н.П.Клокова. Тензорезисторы Теория, методики расчета, разработки. 1990. 224 с.
- Шельмергор Т.Д., Стрельцова Н.Н. Пленочные пьезоэлектрики. М., Радио и связь. 1986. 136 с.
- А.Кинлок. Адгезия и адгезивы. Мир. Пер. с англ. М., 1991, 484 с.
- Е.З. Мейлихов И.С.Григорьев. Свойства материалов. Справочник.